インバータ用の 省エネ SiC パワー素子

エネルギーネットワークの未来に向けて

エネルギーネットワークを支える省エネ

SiC半導体材料を用いたパワー素子の研究開発が近年とみに活発化しています。SiCパワー素子はエネルギーネットワークの中のキーコンポーネントである低損失スイッチング素子として有望視されているもので、産総研ではSiCの単結晶成長から素子開発、インバータ応用技術開発まで、強力に進めています。ここでは私たちが開発したSiCスイッチング素子の成果を紹介します。

省エネSiCスイッチング素子の開発

MOSゲート素子は電圧制御型なので使い易く、現在Si素子でもIGBTやMOSFETの形で、数多く実用化されていますが問題点も残されています。SiC-MOSFETが抱える問題点は、MOS界面の界面準位密度が大きく、チャネル移動度が小さいことです。そこで私たちは、独自の新構造素子IEMOSFET(図1)を考案し、構造パラメータの最適化を図るとともに、産総研が開発した界面準位低減策(2種のウェハ結晶面の内のカー

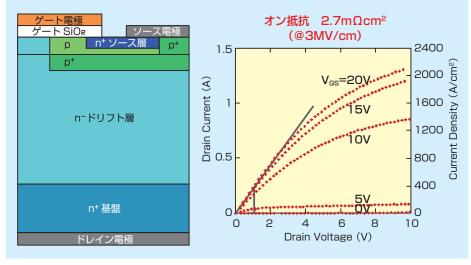


図 1 試作した SiC-IEMOSFET の素子構造(左)と出力特性(右)

ボン面の利用、独自のゲート酸化・後処理技術)を適用しました。その結果、耐圧 700 V でオン抵抗 2.7 m Ω cm²、チャネル移動度 $72 \text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ を得ることができました。このオン抵抗値は Si-IGBT の約1/5で、SiC-MOSFET としては世界最小です。さらに 0.8 mm 角チップで数 A の電流を高速でスイッチできることも確認しています。

SiC-MOSFETのもうひとつの問題は、ゲート酸化膜の信頼性が確定していないことです。それに対して、静電誘導トランジスタSITは、pn接合型ゲート構造のFETであるために酸化膜信頼性の問題がなく、またチャネル移動度はSiC結晶本来の高い電子移動度そのものであることから、低オン抵抗が期待されます。

図2は私たちの研究センターで試作した独自の埋込ゲート SiC-SIT です。微細な埋込ゲート構造の製作技術がポイントです。ノーマリーオンではありますが、耐圧 700V (Vg=-12V) で1.01m Ω cm² と IEMOSFET よりさらに小さい世界最小のオン抵抗を実現できました。

私たちが試作したこれらのSiCスイッチング素子の性能は、いずれもSi-IGBTをはるかに凌駕しており、今後インバータの一層の低損失化に寄与するものと考えられます。

ます。 パワーエレクトロニクス研究センター **奥村 元**

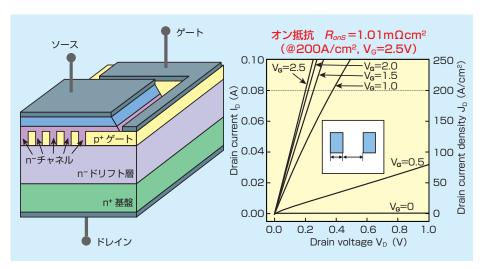


図2 試作した SiC-SIT の素子構造(左)と出力特性(右)